

## 資料提供招請に関する公表

次のとおり物品の導入を予定していますので、当該導入に関して資料等の提供を招請します。

令和5年11月13日

国立大学法人島根大学長 服部 泰直

◎調達機関番号 415 ◎所在地番号 32

○第3号

### 1 調達内容

(1) 品目分類番号 24

(2) 導入計画物品及び数量

透過型電子顕微鏡システム 一式

(3) 調達方法 購入等

(4) 導入予定時期

令和7年3月以降

(5) 調達に必要なとされる基本的な要求要件

A LaB6 電子銃を搭載し、最高加速電圧が 200kV 以上であり、最低加速電圧が 80kV 以下であること。

B 透過電子顕微鏡 (TEM) 格子分解能が 0.14nm 以下であること。

C 明視野像および暗視野像を取得できること。

D 走査透過電子顕微鏡法 (STEM) の機能を有していること。

E 走査透過電子顕微鏡 (STEM) 格子分解能が 1.0nm 以下であること。

F エネルギー分散型 X 線分析装置 (EDX) を有していること。

G Windows®上で動作する操作ソフトウェアを有していること。(Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。)

H 像観察室下に電子顕微鏡像および回折図形観察用の CMOS カメラを有していること。

I 合成角が±20 度以上の角度範囲で 2 軸傾斜させた強磁性体試料の観察が可能なこと。

J 収束電子線回折 (CBED) 法による回折図形が得られること。

K オリジン電気株式会社製のイオンビーム照射装置 (RIB-20S) を装着することが可能な取付口を

有する電子顕微鏡を含んでいること。

- 2 資料及びコメントの提供方法 上記1(2)の物品に関する一般的な参考資料及び同(5)の要求要件等に関するコメント並びに提供可能なライブラリーに関する資料等の提供を招請する。
  - (1) 資料等の提供期限 令和5年12月15日17時00分(郵送の場合は必着のこと。)
  - (2) 提供先 〒690-8504 松江市西川津町1060 国立大学法人島根大学財務部経理・調達課 西村 修平 電話 0852-32-6027
- 3 説明書の交付 本公表に基づき応募する供給者に対して導入説明書を交付する。
  - (1) 交付期間 令和5年11月13日から令和5年12月15日まで。
  - (2) 交付場所 上記2(2)に同じ。
- 4 説明会の開催 本公表に基づく導入説明会を開催する。
  - (1) 開催日時 令和5年11月17日11時00分
  - (2) 開催場所 島根大学本部棟1階第一会議室(又はオンライン開催)(オンライン開催の詳細は導入説明書交付時に別途案内する。)
- 5 その他 この導入計画の詳細は導入説明書による。なお、本公表内容は予定であり、変更することがあり得る。
- 6 Summary
  - (1) Classification of the products to be procured : 24
  - (2) Nature and quantity of the products to be purchased : 1 set of Transmission Electron Microscope System
  - (3) Type of the procurement : Purchase
  - (4) Basic requirements of the procurement :
    - A LaB6 electron gun is equipped, and the maximum and minimum acceleration voltages are 200 kV or higher and 80 kV or lower, respectively.
    - B Transmission electron microscopy (TEM) lattice resolution is less than 0.14 nm.

C TEM diffraction-contrast bright-field and dark-field images can be taken.

D Scanning transmission electron microscopy (STEM) function is available.

E STEM lattice resolution is less than 1.0 nm.

F Energy dispersive X-ray analyzer (EDX) is available.

G Operation software running on Windows® is available.

(Windows is a registered trademark or trademark of US Microsoft Corporation.)

H Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) camera for observing electron microscope images and diffraction patterns is installed.

I Observe of ferromagnetic samples tilted in double axes within a composite angle range of  $\pm 20$  degrees or more.

J Convergent-beam electron diffraction (CBED) patterns can be taken.

K Electron microscope with a mounting port allowing attachment of an ion irradiation device, RIB-20S, manufactured by Origin Co., Ltd is contained.

(5) Time limit for the submission of the requested material : 17:00 15 December, 2023

(6) Contact point for the notice : NISHIMURA Shuhei, Accounts Division, Finance Department, The National University Corporation Shimane University, 1060 Nishikawatsu-cho Matsue-shi 690-8504 Japan, TEL 0852-32-6027